

دکتر اکبر اسـحاقی، نویـسندهی اول مقاله، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد

لایهنشانی و بررسی خواص لایه نازک کربن شبه الماسی اعمال شده بر پنجره مادونقرمز سیلیکونی

اكبر اسحاقى*، عباسعلى أقايى

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

چکیده: پنجرههای مادون قرمز به عنوان محافظ سامانههای الکترواپتیک در صنایع هوایی و فضایی مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال این پنجرهها تحت تاثیر شرایط نامساعد محیطی قرار گرفته و در نتیجه عملکرد سامانههای الکترواپتیک نیز دچار اختلال میشود. اعمال پوششهای محافظ بر پنجرههای مادون قرمز باعث افزایش عملکرد این پنجرهها خواهد شد. در ایس تحقیق لایه نازک کرین شبه الماسی با استفاده از دو گاز هیدروژن و متان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده به کمک پلاسما با منبع تغذیه فرکانس رادیویی (RF-PECVD) بر سطح پنجرههای مادون قرمز ساییکونی اعمال گردید. ارزیابی ساختاری پوشش با استفاده از آنالیز پراش سنجی پرتوایکس و طیف سنجی رامان صورت گرفت. به منظور تعیین ضریب شکست لایه نازک کرین شبه الماسی روش بیضی سنجی مورد استفاده قدرار گرفت. طیف بازتداب نموندهها با استفاده از دستگاه ولای کرین شبه الماسی روش بیضی سنجی مورد استفاده قدرار گرفت. طیف بازتداب نموندها با استفاده از دستگاه ولایه ماد مالایم و شدید نیز با هدف بررسی مقاومت سایشی پوشش صورت گرفت. تایج نشان داد با اعمال لایه نازک کرین شبه الماسی ملایم و شدید نیز با هدف بررسی مقاومت سایشی پوش صورت گرفت. تایج نشان داد با اعمال لایه نازک کرین شبه الماسی میزان عبور بسترههای سیلیکونی افزایش یافته است. همچنین نتایج تست سایش نشان داد با اعمال لایه نازک کرین شبه الماسی میزان عبور بسترهای سیلیکونی افزایش یافته است. همچنین نتایج تست سایش نشان داد با عامال لایه نازک کرین شبه الماسی کلمات گلیدی: پنجره مادون قرمز، خواص ایتیکی، کرین شبه الماسی، لایه ناز داز ک.

لما**ت کلیدی:** پنجره مادون فرمز، خواص اپتیکی، کربن سبه الماسی، ^ب

۱– مقدمه

فناوری مادون قرمز یکی از فناوری های جدید و پرکاربرد در زمینه های گوناگون صنعتی، نظامی و پزشکی است. از جمله مهمترین کاربردهای پنجره های مادون قرمز می توان به دام محافظ ردیاب موشکهای جنگی، محافظ سیستم تصویربرداری و انتقال سیگنال مادون قرمز در موشکهای مافوق صوت، سیستم های نظارت، سامانه های شناسایی هوایی، سیستم رادارهای لیزری، دوربین های مادون قرمز پزشکی و نیز کاربردهای آزمایشگاهی اشاره کرد[۱-۵]. پنجره های مادون قرمز به سه دسته تک کریستال، پلی کریستال و شیشه تقسیم می شوند. سیلیکون به دو شکل تک کریستال و پلی کریستال به عنوان پنجره مادون قرمز استفاده می شود[۱]. در این تحقیق از قرص سیلیکونی پلی کریستال به عنوان زیر لایه استفاده شد.

شفافیت بالای یک پنجره مادونقرمز از اهمیّت ویژهای برخوردار است. سیلیکون به عنوان پنجره مادونقرمز در محدوده طولموجی ۵–۳ میکرون کاربرد بیشتری دارد اما ضریب شکست سیلیکون به اندازهای بالا است که اتلاف بازتابشی قابلتوجهی را ایجاد میکند، به طوری که میزان عبور یک زیرلایه سیلیکونی جلا داده شده در محدوده ۵–۳ میکرون حدود ۵۰٫۵۸ میباشد[۶]. از اینرو، این ماده به تنهایی نمیتواند نیازهای کاربردهای عملی را برآورده سازد و ضرورت اعمال یک پوشش ضدبازتاب مشخص میشود.

یکی از چالشهای دیگر در استفاده از پنجرههای مادون قرمز، حفاظت آن ها از آسیب به وسیله برخورد با ذرات است. زیرا این عنصر خارجی ترین بخش سامانه بوده و همواره در معرض عوامل بسیاری مانند: فشار اتمسفر، تنش پرتاب، شوک حرارتی ناشی از برخورد قطرات سرد، فرسایش، برخورد ذرات جامد و غیره می باشد. بنابراین، انتخاب یک ماده مناسب به منظور افزایش مقاومت مقالات پژوهشی

سایشی سیلیکون نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. کرین شبه الماسی، پوششهای ژرمانیم-کربن، پوششهای پایه فسفر و الماس از جمله پوششهایی است که به عنوان پوشش مقاوم به سایش در پنجرههای مادون قرمز کاربرد دارد[۱و۷]. در نتیجه به منظ ور بهب ود عبوردهی به واسطه کاهش بازتاب و حفاظت در برابر فرسایش باران و ماسه، نیاز به پوششهای ضدبازتاب و محافظ احساس میشود. کربن شبه الماسی دارای ضریب شکست متغیر در محدوده ۱/۲ تا ۲/۲ است، لذا میتواند به عنوان پوشش ضدبازتاب استفاده شود. همچنین از آن جایی که این پوشش دارای سختی متغیر (محدوده کمتر از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کرای می شد، برای محافظت در مقابل سایش ذرات جامد، بسیار عالی است. این ماده، چسبندگی بسیار خوبی به ژرمانیم و سیلیکون دارد[۱۹۵]. در این تحقیق ابتدا پارامترهای بهینه برای لایهنشانی کربن شبه الماسی با ضریب شکست مناسب به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده به کمک پلاسما تعیین شد. سپس ضخامت بهینه برای داشتن بیشینه عبور محاسبه گردید و در ادامه لایه نازک کربن شبه الماسی به عنوان یک پوشش ضدبازتاب و مقاوم به سایش بر یک طرف و دو طرف پنجرههای مادون قرمز سیلیکونی

۲- فعالیتهای تجربی

۲-۱- مواد

برای ساخت لایه نازک کربن شبه الماسی از دو گاز هیدروژن و متان با خلوص به ترتیب ۹۹/۹۹۸ و ۹۹/۹۹۹ ٪ استفاده شد. همچنین از قرص سیلیکونی خام (بدون هیچ گونه پوششی) با قطر ۲۵ میلیمتر به عنوان زیرلایه استفاده گردید.

۲-۲-لايەنشانى

در این پژوهش ابتدا نمونهها با آب و صابون و الکل به دقت شستشو شدند. در مرحله بعدی فرآیند پلاسما اچینگ هیدروژن به عنوان فرآیندی تکمیلی جهت رفع آلودگیهای ناخواسته احتمالی و فعالسازی سطح به منظور افزایش چسبندگی پوشش به سطح زیرلایـه انجام گرفت[۹]. پارامترهای فرآیند پلاسما اچینگ در جدول ۱ آورده شده است. پس از این فرآیند، فرآیند لایه نشانی به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده به کمک پلاسما صورت گرفت. پارامترهای این فرآیند در جدول۲ نشان داده شده است.

جدول ۱ - پارامترهای فرآیند پلاسما اچینگ هیدروژن	
مقدار	پارامتر (واحد)
۱۰-۵	فشار اوليه (torr)
$1 \cdot \cdot \pm 7$	توان فرکانس (W)
46/0	دبی گاز هیدروژن (sccm)
١	فشار کاری (torr)
۲۰	زمان اچینگ (min)
دمای محیط	دمای فرآیند (oC)
١/۵	فاصله آند و کاتد (cm)
عدول ۲ -شرایط فرآیند لایه نشانی لایه نازک کربن شبه الماسی	
مقدار	پارامتر (واحد)
$1 \cdot \cdot \pm 7$	توان فركانس (W)
۳۸/۴ به ۹/۶	دبی گاز هیدروژن به متان (sccm)
١	فشار کاری (torr)
دمای محیط	دمای فرآیند (°C)
۱/۵	فاصله آند و کاتد (cm)

فصلنامه سراميك ايران شماره ٥٢ زمستان ٦٦

41

۲-۳- روشهای مشخصهیابی

قالات پژوهشی

تشکیل لایه نازک کربن شبه الماسی و حالت کربن در ساختار با استفاده از آنالیز طیفسنجی رامان ارزیابی شد. در این تحقیق از دستگاه طیفسنج رامان مدل Senterra ساخت شرکت آلمانی Burker استفاده و طیفسنجی در محدوده طولموجی ۲۲۰۰ nm انجام شد.

ساختار لایه نازک کربن شبه الماسی با استفاده از دستگاه پراش سنج پرتو ایکس مدل D8 Advance از شرکت Burker ساخت کشور آلمان مورد بررسی قرار گرفت. در پراش سنجی پرتو ایکس از تابش Ka مس استفاده شد و طیف سنجی در بازه ۸۰–۶۵–۲۵ صورت گرفت.

برای تعیین منحنی ضریب شکست لایه نازک کربن شبه الماسی از دستگاه بیضی سنج مدل Horiba در محدوده طول موج nm ۲۰۰۰–۳۷۰ استفاده شد. طیف بازتاب توسط دستگاه Spectrophotometer یا UV-VIS-NIR Rrcording Spectrophotometer بد ذکر است دقت کالیبره دستگاه استفاده شده در حدود /۰٪ عبوردهی و خطای دستگاه در حد صدم درصد عبوردهی می باشد. همچنین به منظور بررسی میزان شفافیت نمونه های سیلیکونی از دستگاه FTIR استفاده گردید. این طیف سنجی در محدوده طول موجی μα 10–۲ انجام گرفت. مقاومت سایشی پوشش توسط تست سایش ملایم و شدید بررسی شد.

برای انجام تست سایش ملایم پارچه کتانی و نمونه پوشش داده شده لازم مییاشد. بعد از انجام این تست، نباید هیچ نشانه واضحی از بدتر شدن کیفیت لایه نظیر وجود رگه یا خراش در قطعه مشاهده گردد. روش تست به این صورت است که در زمان ۱ ساعت پس از تست رطوبت، نمونه لایهنشانی شده، تحت سایش ملایم قرار می گیرد. این کار با سایش سطح لایهنشانی شده به کمک یک پارچه کتانی درشت بافت (که استاندارد MIL CCC-0440 را پاس مینماید) با ضخامت ۶/۶ میلیمتر که دارای پهنای ۵/۹ میلیمتر میباشد، صورت می گیرد. این پارچه بر روی تستر ثابت شده و سطح آن را به طور کامل می پوشاند. تستر باید عرض سطح قطعه را از یک نقطه تا نقطه دیگر در یک مسیر، برای ۲۵ دور کامل (۵۰ بار رفت و برگشت) با نیـروی حـداقل ۱ پوند که به طور متوالی اعمال می گردد طی نماید. طول مسیر باید حداقل ۲ برابر پهنای پارچه بوده و جهـت اعمال نیـرو بایـ همواره بر سطح قطعه عمود میباشد. سپس قطعه بر اساس روش تمیزکاری سطوح لایهنشانی شـده و نه کی گردیـده و آسیبهای احتمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

برای انجام تست سایش شدید پاک کن استاندارد و نمونه پوشش داده شده لازم مییاشد. بعد از تست سایش شدید نباید هیچ گونه آسیب واضحی نظیر کنده شدن لایه و یا خراش در قطعه مشاهده گردد. در این تست لازم است که مقاومت بـه سـایش نمونـه لایهنشانی شده، به کمک مداد پاک کن مورد تأیید استاندارد MIL-E-12397 که بر روی یک تستر قرار گرفته مـورد بررسـی قـرار گیرد. مداد پاک کن باید عرض سطح قطعه را از یک نقطه تا نقطه دیگر در یک مسیر، برای ۱۰ دور کامل بـا نیروئـی برابـر ۲ تـا ۲/۵ پوند که به طور متوالی به آن اعمال میگردد طی نماید. طول مسیر باید تقریباً سه برابر قطر مـداد پـاک کـن بـوده و جهـت اعمال نیرو باید همواره بر سطح قطعه عمود می باشد. سپس قطعه بر اساس روش تمیز کاری سطوح لایهنشانی شده تمیز خـشک گردیده و سپس آسیبهای احتمالی مورد بررسی قرار میگیرد.

۳-نتایج و بحث

نتیجه آنالیز طیفسنجی رامان در شکل ۱ نشان داده شده است. تشکیل پیک D (ناشی از پیوندهای گرافیتی نامنظم) و نیز پیک G (ناشی از پیوندهای گرافیتی تک کریستال) به ترتیب در عددهای موجی ^۲-۱۳۴۰ و ^۲-۱۵۵۰ تشکیل لایه نازک کربن شبهالماسی را اثبات میکند[۱۹۰۹]. میزان نسبی شدت ID/IG و نیز موقعیت پیک G، نسبت SP³/SP² را در پوشش مشخص میکند. با افزایش نسبت ID/IG میزان SP² در پوشش افزایش مییابد[۱۳و۲].

طیف پراش سنجی پرتو ایکس لایه نازک کربن شبه الماسی در شکل ۲ نشان داده شده است. عدم وجود پیک تیز در طیف مشخص می کند که پوشش دارای ساختاری آمورف است[۱۴و۱۲].

F



پارامترهای فرایند لایهنشانی به گونهای انتخاب گردیده است که ضریب شکست پوشش، به مقدار بهینه نزدیک باشد. بـرای ایـن منظور از رابطه ۱ استفاده می شود[۱۵و۱۶].

$$n_{AR} = \sqrt{n_o n_{si}}$$

در این رابطه nan ضریب شکست پوشش ضدبازتاب، on ضریب شکست هوا و nsi no ضریب شکست زیرلایه سیلیکونی در طول موج nn ۲۰۰۰ است که با جایگذاری مقادیر ۱ برای ضریب شکست هوا و ۳۶۴۲۵ برای ضریب شکست سیلیکون، ضریب شکست بهینه پوشش از نظر تئوری در طول موج nn ۴۰۰۰ برابر ۱۸۵۵ بدست می آید[۱۷]. از طرفی چون ضریب شکست لایه نازک کربن شبه الماسی تنظیم پذیر است، می توان در ضمن فر آیند لایه نشانی با تغییر پارامترهای لایه نشانی ضریب شکست پوشش را تا حد قابل قبولی به مقدار ۱۸۵۵ نزدیک کرد[۱۰]. شکل ۳ منحنی ضریب شکست لایه نازک کربن شبه الماسی را نسبت به طول موج نشان می دهد. با توجه به این شکل، لایه نازک کربن شبه الماسی اعمال شده بر سطح نمونه های سیلیکونی دارای ضریب شکست برابر ۲۰۲۲ در طول موج no ۵۵۰ است. بررسی منحنی شکل ۱ نشان می دهد ضریب شکست این لایه در طول موج ma ۱۰۰۰ برابر ۱۸۹۵ شده است. بنابراین از شیب نمودار ضریب شکست بر حسب طول موج و با استفاده از روش برونیابی می توان نتیجه گرفت که ضریب شکست پوشش در طول موج mo ۲۰۰۰ با مقدار تئوری (بدست آمده از رابطه ۱) مطابقت خوبی دارد.

پس از تعیین ضریب شکست بهینه، ضخامت بهینه اپتیکی جهت برخورداری کربن شبه الماسی از خواص ضدبازتابی با استفاده از رابطه(۲) بدست می آید[۱۵و۱۶]:

$$d_{AR} = \frac{n\lambda_0}{4n_{AR}}$$

فصلنامه سراميك

ايران شماره ٥٢ زمستان ٩٦

مقالات يژوهش

در این رابطه d_{AR} ضخامت بهینه اپتیکی (nm)، مرام طول موج (nm) و n_{AR} ضریب شکست بدست آمده از شکل ۱ است. با جای گذاری مقادیر در رابطه (۲) ضخامت بهینه بدست میآید:



بنابراین ضخامت بهینه لایه نازک کربن شبه الماسی برای داشتن کمترین بازتاب برابر ۵۴۰ نانومتر است که در ادامه این ضخامت در دو حالت یک طرف و دو طرف سطح نمونههای سیلیکونی اعمال شد.

به منظور بررسی شفافیت نمونه های سیلیکونی پس از اعمال لایه نازک کربن شبه الماسی، طیف عبور در سه حالت نمونه بدون پوشش، یک طرف پوشش دار و دو طرف پوشش دار تهیه گردید. این طیف سنجی در محدوده ۱۵–۲ میکرون صورت گرفته که در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴- طیف عبور پنجره مادونقرمز سیلیکونی دو طرف پوششدار، یک طرف پوششدار و بدون پوشش

همان طور که در شکل ۴ مشاهده می شود با اعمال لایه نازک ضدبازتاب کربن شـبه الماسـی شـفافیت در محـدوده مـادون قرمـز افزایش می یابد که این میزان افزایش برای حالت دو طرف پوشش دار بیشتر اسـت. بنـابراین از لایـه نـازک کـربن شـبه الماسـی می توان به عنوان یک پوشش اپتیکی به منظور افزایش شفافیت پنجرههای مادون قرمز استفاده کرد.

با استفاده از میزان عبور نمونه بدون پوشش T₀ و نمونه دارای یک طرف پوشش T طبق رابطه(۳) می توان ضریب جذب نمونه ها را به دست آورد.

$$\alpha = -\frac{1}{d} Ln(\frac{1}{\tau})$$

5

مقالات پژوهشی

۳)

در رابطه (۳) d ضخامت نمونه می باشد.

منحنی ضریب جذب برحسب طول موج در شکل ۵ آمده است. همان طور که مشاهده می شود پوشش دارای ضریب جـذب بـسیار پایین در محدوده طول موجی ۱۵–۲ میکرون می باشد.



شکل ۵- منحنی ضریب جذب لایه نازک کربن شبه الماسی

برای بررسی مقاومت به سایش پوشش تست سایش ملایم به این صورت انجام شد که پارچه کتانی برای ۲۵ دور کامل با نیروی برابر با ۱ پوند روی سطح نمونه اعمال شد. بعد از انجام این تست، هیچ نشانه واضحی از بدتر شدن کیفیت لایه نظیر وجود رگ یا خراش در قطعه مشاهده نشد و نمونه سیلیکونی دارای پوشش کربن شبه الماسی با ضخامت ۵۴۰ nm این تـست را کـه طبـق استاندارد MIL CCC-c-440 صورت گرفت، با موفقیت گذراند.

برای بررسی مقاومت به سایش نمونه سیلیکونی طبق استاندارد MIL-E-12397، پاککن برای ۱۰ دور کامل با نیروی عمودی ۲٫۵ پوند روی سطح پوشش اعمال شد. بعد از انجام تست سایش شدید هیچگونه آسیب واضحی نظیر کندهشدن لایه و یا خراش در قطعه مشاهده نشد و نمونه سیلیکونی دارای پوشش کربن شبه الماسی با ضخامت ۵۴۰ nm این تست را نیـز با موفقیت گذراند.

۴- نتیجه گیری

در این پژوهش لایه نازک ضدبازتاب کربن شبه الماسی با استفاده از دو گاز هیدروژن و متان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده به کمک پلاسما با منبع تغذیه فرکانس رادیویی (RF-PECVD) بر سطح پنجره مادونقرمز سیلیکونی اعمال شد و نتایج زیر به دست آمد:

- ضریب شکست لایه نازک کربن شبه الماسی در این پژوهش با ضریب شکست تئوری بدست آمده از روابط فیزیکی مطابقت دارد که در نتیجه می تواند به عنوان یک پوشش ضدباز تاب عمل کند بنابراین ضخامت بهینه اپتیکی در طول مـوج ۴۰۰۰ nm نانومتر برابر ۵۴۰ nm محاسبه گردید.
- اثبات شد که با اعمال لایه نازک کربن شبه الماسی شفافیت پنجره های مادون قرمز سیلیکونی در محدوده طول موج مادون قرمز افزایش می یابد.
- همچنین نتیجه میشود که با اعمال لایه نازک کربن شبه الماسی بر روی پنجرهه ای مـادونقرمـز سـیلیکونی مقاومـت بـه سایش بهبود مییابد.

فصلنامه سرامید ایران شماره ۵۲ زمستان ۲۹

مقالات يژوهش

مراجع

مقالات يژوهشى

- [1] D. C. Harris, "Materials for infrared windows and domes", SPIE Optical Engineering Press, Washington , 1999.
- [2] Y.Liu, Y.He, Z. Yuan, J. Zhu and J. Han, "Numerical and experimental study on thermal shock damage of CVD ZnS infrared window material", Journal of Alloys and Compounds Vol. 589, pp. 101–108, 2014.
- [3] B. Tang, Y. Yang, Y. Fan and L. Zhang, "Barium Gallogermanate Glass Ceramics for Infrared Applications, Journal of Materials *Science* and *Technology*, Vol. 26, pp. 558-563, 2010.
- [4] M. Hopf and J. U. G. Hopf, "Near Infrared Transillumination in Acute Maxillary Sinusitis: Theoretical Background – Clinical Application Diagnostic Potential – Limitations", Medical Laser Application Vol. 18, pp. 217–231, 2003.
- [5] D. C. Harris, "Durable 3–5 mm transmitting infrared window materials", Infrared Physics & Technology Vol. 39, pp. 185–201, 1998.
- [6] A. Rogalski and K. Chrzanowski, "Infrared devices and techniques", Opto-Electronics Review, Vol. 10, pp. 111–136, 2002.
- [7] A.A. Deom, A. Luc, S. Amara and D.L. Balageas, "Towards more realistic erosion simulation tests for high velocity EM and IR windows", Wear, pp. 13–24, 1999.

[۸] مجیری، ف، لایهنشانی و ارزیابی اثرات لایه ناز ک DLC بر بهبود عملکرد سلول های خورشیدی سیلیکونی، پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد (شناسایی و انتخاب مواد)، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،

اردیبهشت ماه ۱۳۹۲.

- [9] W. Seok Choi, K. Kim, J. Yi and B. Hong, "Diamond-like carbon protective anti-reflection coating for Si solar cell", Materials Letters 62 (2008) 577–580.
- [10] J. Robertson, "Diamond-like amorphous carbon", Materials Science and Engineering R, Vol. 37, pp. 129-281, 2002.
- [11] X. B. Yan, T. Xu, S. R. Yang, H. W. Liu and Q J Xue, "Characterization of hydrogenated diamond-like carbon films electrochemically deposited on a silicon substrate", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 37, pp. 2416-2424, 2004.
- [12] L. Qiang, B. Zhang, Y. Zhou and J. Zhang, "Improving the internal stress and wear resistance of DLC film by low content Ti Doping", Solid State Sciences, Vol. 20 pp. 17-22, 2013.
- [13] T. Kitagawa, K. Miyauchi, N. Toyoda, K. Kanda, T. Ikeda, H. Tsubakino, J. Matsuo, Sh. Matsui and I. Yamada, "Influence of residual Arb in Ar cluster ion beam for DLC film formation", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Vol. 206, pp. 884–888, 2003.
- [14] R. Chakraborty, R. Mandal and R. Das, "Studies on the influence of argon flow rate on PECVD grown diamond-like nanocomposite film", Optik, Vol. 124 pp. 6915–6918, 2013.
- [15] F. J. Pern, Zh. Panosyan, A. A. Gippius, J. A. Kontsevoy, K. Touryan, S. Voskanyan and Y. Yengibaryan, "Diamond-like carbon coatings as encapsulants for photovoltaic solar cells", Prepared for the 31st IEEE Photovoltaic Specialists Conference and Exhibition Lake Buena Vista, Florida January, pp. 3–7, 2005.
- [16] O. S. Heavens, "Thin film physics", Distributed in the U.S.A by Halsted press, NewYork, 1970.